

При увеличении состава  $x > 0.42$  решетка приобретает слоистость, которая особенно проявляется в неотожженном образце 2 вдоль плоскости (100). Температура СФП и вся петля гистерезиса смешены в область более высоких температур (рис. 2), СФП не наблюдается при более высокой концентрации НТ.

В данном случае происходит СФП 1-го рода, так что имеет место область метастабильных состояний, где возникают зародыши новой фазы. Их возможное затруднено стрикционной блокировкой [3, 4], т. е. неоднородной деформацией вблизи зародыша. Величина интервала температур, в котором появились зародыши, но СФП еще не произошел (область гистерезиса), зависит от величины упругих модулей кристалла.

Решеточная часть, которая в данном веществе является основной составляющей МВ, отражает изменение природы химической связи в результате СФП [5]. Для узкощелевых полупроводников изменение решеточной составляющей МВ от состава  $x$  и температуры  $T$  будет определяться  $\gamma_{per}$  и  $\gamma_{oc}$  [6], а также ван-Флековским парамагнитным вкладом  $\gamma_{WF}$ , зависящим от несферичности электронного облака ионов в решетке. Действительно, при понижении концентрации НТ, как видно из рис. 1, происходит увеличение диамагнитного вклада в МВ решетки  $\gamma_{oc}$ . В двухфазной области  $\gamma_{per}$  определяется эффективным радиусом атомов [5], а уменьшение  $\gamma_{oc}$  обусловлено увеличением ширины запрещенной зоны при переходе в орторомбическую структуру ( $\gamma_{SnSe} \approx 27.6 \text{ см}^3/\text{г}$  и не зависит от температуры в интервале  $77 \pm 300 \text{ К}$ ).

Таким образом, показано, что аномалия МВ — петля гистерезиса имеет место для определенных состава и концентрации НТ, при увеличении концентрации или ограничении степени свободы, по-видимому, исключается сдвиг подрешеток [2], поэтому гистерезис на МВ не наблюдается.

Авторы выражают благодарность Г. В. Лашкареву, В. И. Литвинову и И. М. Раренко за полезные обсуждения.

### Л и т е р а т у р а

- [1] Шмытко И. М., Кучеренко И. В., Шотов А. П. и др. // ФТТ. 1980. Т. 22. В. 5. С. 1384—1387.
- [2] Серебрянская Н. Р., Кабалкина С. С., Кучеренко И. В. // ФТТ. 1980. Т. 22. В. 11. С. 3465—3466.
- [3] Либшиц И. М., Гулида Л. С. // ДАН СССР. 1952. Т. 87. В. 3. С. 377—380.
- [4] Нечипоренко И. Н. // ФНТ. 1975. Т. 1. С. 1481—1495.
- [5] Вонсовский С. В. Магнетизм. М., 1971. 1032 с.
- [6] Фальковский Л. А., Бродовой А. В., Лашкарев Г. В. // ЖЭТФ. 1981. Т. 80. В. 1. С. 334—348.

Черновицкий государственный университет

Получено 10.06.1988  
Принято к печати 28.11.1988

ФТП, том 23, вып. 4, 1989

## ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В $p$ -GaAs, ЛЕГИРОВАННОМ МЕДЬЮ, МЕТОДАМИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ГЛУБОКИХ УРОВНЕЙ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Быковский В. Ю., Вовненко В. И., Дмитрук Н. Л.

В последние годы широкое распространение получил метод нестационарной спектроскопии глубоких уровней (НСГУ) [1-3], позволяющий получить количественные данные о параметрах глубоких уровней в полупроводниках: коэффициентах захвата носителей тока, их энергетическом положении и концентрации. Представляет интерес применение данного спектроскопического метода

к хорошо изученному ранее другими не столь информативными методами объекту — GaAs, легированному медью [4]. Кроме того, весьма перспективным представляется сочетание метода НСГУ с фотолюминесценцией, позволяющее определить полный энергетический спектр глубоких уровней в таком сложном полупроводнике, каким является  $p$ -GaAs(Zn, Cu), а также оценить сечения захвата основных и неосновных носителей тока. Это проливает свет на механизм захвата носителей тока на глубокие уровни и природу центров «быстрой» и «медленной» рекомбинации [5] в арсениде галлия.

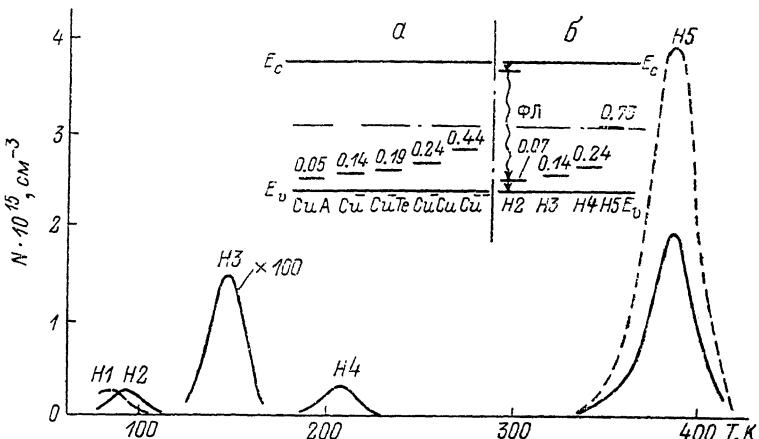


Рис. 1. НСГУ спектры исходного (штрихи) и легированного Cu (сплошная линия) образцов  $p$ -GaAs (Zn).

На вставках: а) глубокие уровни в GaAs, обусловленные Cu, по данным [4, 8]; б) глубокие уровни, по нашим данным.

Исследовался монокристаллический  $p$ -GaAs(Zn) с концентрацией дырок  $p_0 = 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Медь вводилась путем электролитического осаждения на поверхность и последующего отжига образцов при температуре  $800^\circ\text{C}$  в течение 1 ч в вакууме. Используемый нами метод токовой НСГУ, а также методика расчета параметров глубоких уровней описаны в [6]. Для выяснения механизма

Параметры локальных центров в  $p$ -GaAs(Zn, Cu)

Уровень	$\Delta E, \text{эВ}$	$c_p, \text{см}^3/\text{с}$	$c_{\eta}, \text{см}^3/\text{с}$	$N, \text{см}^{-3}$
$H1^*$	0.03	$3 \cdot 10^{-9}$	—	$2 \cdot 10^{14}$
$H2^{**}$	0.07	$2 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{14}$
$H3^{**}$	0.14	$6 \cdot 10^{-7}$	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$2 \cdot 10^{13}$
$H4^{**}$	0.24	$5 \cdot 10^{-9}$	$< 3 \cdot 10^{-10}$	$3 \cdot 10^{14}$
$H5^*$	0.73	$2 \cdot 10^{-6}$	$\sim 2 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{15}$
$H5^{**}$	0.73	$2 \cdot 10^{-6}$	$\sim 2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{15}$

Примечание. \* Исходные образцы. \*\* Образцы с медью.

электронных переходов и определения коэффициентов захвата неосновных носителей на тех же кристаллах измерялась фотолюминесценция (ФЛ) при возбуждении Не—Не-лазером.

На рис. 1 представлены НСГУ спектры исходного и содержащего Cu образцов. В исходном  $p$ -GaAs(Zn) наблюдаются два уровня —  $H1$  и  $H5$ , а в содержащем Cu образце — уже четыре: вместо уровня  $H1$  появляются уровень  $H2$ , два новых уровня —  $H3$  и  $H4$ , а также уровень  $H5$ , концентрация которого уменьшается приблизительно вдвое. Параметры наблюдаемых уровней приведены в таблице.

$H5$  — это хорошо известный уровень  $EL2$  [7], изучением которого занимаются многие исследователи, однако единого мнения относительно его природы пока не существует. С атомами меди связаны уровни  $H2$ ,  $H3$  и  $H4$ . Уровень,

близкий по энергии к  $H2$  ( $E_e \approx 0.05$  эВ), наблюдал Ширафуджи [8] и связал его проявление с ассоциацией атомов меди с дефектами решетки либо с мелкими акцепторами. Так как  $H2$  трансформировался из уровня  $H1$ , который может быть обусловлен неконтролируемой примесью Si [9] либо Zn [10], возможно, за природу уровня  $H2$  ответственны комплексы CuSi или CuZn.  $H4$  и  $H3$  по своему энергетическому положению совпадают с уровнями, обусловленными комплексами CuCu<sup>-</sup> и однозарядными атомами меди Cu<sup>-</sup> соответственно [6].

На рис. 2 представлены результаты изучения ФЛ образцов, содержащих Cu. Заметим, что на исходных образцах ФЛ практически не наблюдалась, т. е. выход излучательной рекомбинации составляет менее чем  $10^{-5}$  часть интенсивности возбуждения. Кроме близкрайевой полосы излучения, в спектрах ФЛ имеется полоса с  $h\nu_m = 1.35$  эВ, возникающая вследствие излучательной рекомбинации связанных на мелких донорах неравновесных электронов с дырками на акцепторе Cu<sub>Ga</sub> [11] и эффективно гасящаяся в диапазоне температур 120–

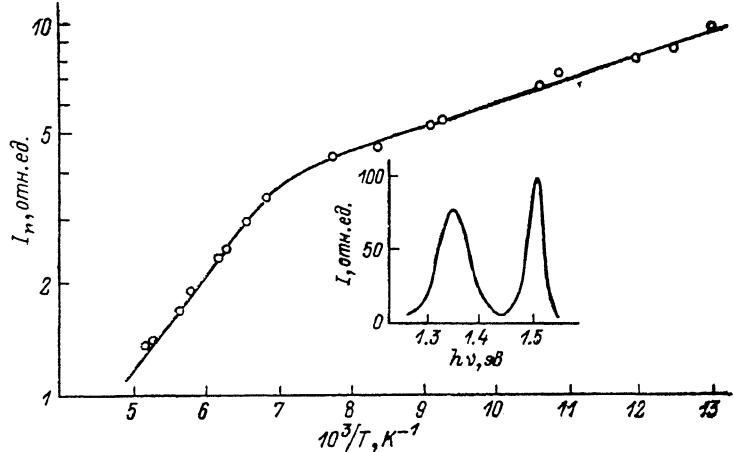


Рис. 2. Температурное гашение полосы ФЛ с  $h\nu_m = 1.35$  эВ в  $p$ -GaAs (Zn, Cu).  
На вставке — спектр ФЛ при  $T = 77$  К.

200 К. Энергия активации акцептора ( $\approx 0.07$  эВ), определенная из кривой температурного гашения интенсивности ФЛ, совпадает с энергией активации уровня  $H2$  по данным НСГУ. Этот факт, а также то, что уровень  $H2$  возникает одновременно с появлением полосы ФЛ с  $h\nu_m = 1.35$  эВ, позволяют утверждать, что акцепторы, через которые идет излучательная рекомбинация электронов, обнаруживаются нами в НСГУ измерениях как  $H2$ -центры. Сравнение интенсивности излучения с  $h\nu_m = 1.35$  эВ с интенсивностью возбуждения позволило оценить коэффициент захвата электронов этим центром, а также уровнями  $H3$  и  $H4$  (см. таблицу). Действительно, интенсивность фотолюминесценции можно записать в виде  $I = \beta g_r L$ , где  $\beta$  — внутренний квантовый выход люминесценции (в исследуемых образцах  $\beta \approx 1$ ),  $L$  — интенсивность возбуждения,  $g_r$  — доля носителей, рекомбинирующих через излучательный  $r$ -й канал рекомбинации («медленной»). В случае ФЛ с  $h\nu_m = 1.35$  эВ  $g_r \approx 10^{-2}$ , что свидетельствует о том, что основная часть неравновесных носителей рекомбинирует через безызлучательные  $s$ -центры (эффективность рекомбинации  $\approx c_{ns} N_s$ ). Тогда  $g_r$  можно записать как

$$g_r \approx c_{nr} N_r / c_{ns} N_s \approx \tau_n c_{nr} N_r,$$

где  $N_r$ ,  $N_s$  — концентрации излучательных и безызлучательных центров рекомбинации соответственно,  $\tau_n$  — время жизни неосновных носителей тока (по нашим оценкам,  $\tau_n \approx 10^{-10}$  с). Тогда, зная концентрацию  $H2$ -центров из НСГУ измерений, можно определить коэффициент захвата электронов на эти центры  $c_{nr}$ .

Аналогичным образом оценивается коэффициент захвата электронов на  $H3$ - и  $H4$ -центры с учетом того, что излучение через эти центры в эксперименте

не наблюдалось, т. е. для этих центров  $g_r \approx 10^{-5}$  (чувствительность установки ФЛ).

Таким образом, проведенные исследования  $p$ -GaAs(Zn) позволили впервые оценить коэффициенты захвата как электронов, так и дырок уровнями, связанными с медью, определить характер переходов носителей на глубокие уровни в  $p$ -GaAs(Zn). Сравнение коэффициентов захвата электронов и дырок исследуемыми центрами позволяет сделать вывод о том, что центрами фоточувствительности, по-видимому, являются  $H3$  ( $c_p \gg c_n$ ), а  $H5$  ответственны за «быструю» рекомбинацию ( $s$ -центры,  $c_p \approx c_n$ ), т. е. за время жизни неравновесных электронно-дырочных пар.

### Л и т е р а т у р а

- [1] Lang D. V. // J. Appl. Phys. 1974. V. 45. N 7. P. 3029–3032.
- [2] Лебедев А. А., Кузнецов Н. И. // Препринт ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН СССР. Л., 1986. № 1046.
- [3] Кечек А. Г., Кузнецов Н. И., Лебедев А. А. // Препринт ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН СССР. Л., 1986. № 1144.
- [4] Мильс А. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. М., 1977. 562 с.
- [5] Лашкарев В. Е., Любченко А. В., Шейнкман М. К. Неравновесные процессы в фотопроводниках. Киев, 1981. 261 с.
- [6] Бовиенко В. И., Дмитрук Н. Л., Литовченко В. Г. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 1. С. 156–159.
- [7] Георгиани Н. Н., Тигиняну И. М. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 1. С. 3–45.
- [8] Shirafuji J. // J. Phys. Soc. Japan. 1964. V. 19. N 12. P. 2342. 1965. V. 20. N 8. P. 1527.
- [9] Kressel H., Dunse J. U., Nelson H., Hawrilo F. Z. // J. Appl. Phys. 1968. V. 39. N 3. P. 2006.
- [10] Kendall D. L. // Semiconductors a. Semimetals. N. Y., 1968. V. 4. P. 763.
- [11] Альфёров Ж. И., Гарбузов Д. З., Жиляев Ю. В., Морозов Е. Л., Портной Е. Л. // ФТП. 1968. Т. 2. В. 10. С. 1441–1447.

Институт полупроводников АН УССР  
Киев

Получено 29.06.1988  
Принято к печати 28.11.1988

ФТП, том 23, вып. 4, 1989

## ВЛИЯНИЕ ГЕРМАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРМОДОНРОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ

Дашевский М. Я., Корляков Д. Н.

Изучению влияния изовалентного легирования кремния, в частности легирования его германием, на термодонорный эффект посвящен ряд работ [1–5]. Обнаружено, что введение германия в кремний замедляет кинетику образования термодоноров-1 (ТД-1) при  $T=450$  °C [1–4] и уменьшает их максимальную концентрацию [2, 3]. Однако авторами [5] найдено, что легирование германием не влияет на концентрацию ростовых термодоноров в монокристаллах кремния. По-видимому, образцы, исследованные в работах [1–5], различались по содержанию кислорода.

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влияния легирования германием на кинетику образования и максимальную концентрацию ТД-1 в монокристаллах кремния с различным содержанием кислорода.

### Объекты и методики исследования

Объектами исследования служили бездислокационные монокристаллы кремния и кремния, легированного германием ( $N_{Ge}=10^{20}$  см<sup>-3</sup>), выращенные в направлении  $\langle 111 \rangle$  по методу Чохральского. Концентрации фосфора, кислорода и углерода в ростовых монокристаллах составили  $(1\pm4)\cdot10^{14}$ ,  $(6\pm12)\cdot10^{17}$ ,  $4\cdot10^{16}$  см<sup>-3</sup> соответственно. Исходные образцы были подвергнуты термообра-